光の Liouville-Neumann 方程式

Optical Liouville-Neumann Equation

インペリアル・カレッジ・ロンドン 1 $^{\circ}$ (**D**) 大上 能悟 1

Imperial College London¹, [○]Daigo Oue¹

E-mail: d.oue18@imperial.ac.uk

光マニピュレーションになぜレーザーを使うのか. それはレーザーが高強度光源だからだと言われる. しかし, レーザーは単に高強度なだけではなくコヒーレンスが高いという特徴もある. これを光マニピュレーションに利用することはできないだろうか?

コヒーレントな光でつくられる干渉縞は、インコヒーレントな光を重ねても実現できない、 異常な運動量や角運動量をもつ[1]. これらは コヒーレンスでコントロールできるため、光マニピュレーションに新たな操作自由度をもたらし得る.ここで問題は、既存の古典電磁気学を用いた光圧計算の手法では完全にコヒーレントな光しか扱えないことである.そこで、本研究では部分コヒーレントな光も扱える"密度演算子"を用いた Maxwell 方程式の再定式化と光圧計算の手法を提案する.

Maxwell 方程式は、光の"スピノール"

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{g}{2}} \begin{pmatrix} E \\ iH \end{pmatrix} \tag{1}$$

を用いることによって、光の"Dirac 方程式"(2) に書き直せる. ガウス単位系を用いるものとし、 $g=(4\pi)^{-1}$ とする.

$$i\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{\mathcal{H}}|\psi\rangle,$$
 (2)

$$\hat{\mathcal{H}} = \begin{pmatrix} -i\frac{4\pi}{c}\varepsilon^{-1}\sigma I & -i\varepsilon^{-1}\boldsymbol{\tau}\cdot\nabla\\ -i\mu^{-1}\boldsymbol{\tau}\cdot\nabla & 0 \end{pmatrix}$$
(3)

ここで $D = \varepsilon E$, $B = \mu H$, $j = \sigma E$ とした. また, c は光速, I は 3×3 の単位行列, $\tau = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)^T$ は Gell-Mann 行列 $(\tau_i = -i\epsilon_{ijk})$ を要素に持つベクトルで, (3) の $\hat{\mathcal{H}}$ は非エルミート"ハミルトニアン"である. 真空中では $\hat{\mathcal{H}}$ がエルミートになり, (2) が自由電子の Dirac 方程式と同じ形になることを Barnett が 2014 年に示した [2].

スピノール (1) で"密度演算子"を構成する.

$$\hat{\rho} \equiv |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{g}{2} \begin{pmatrix} EE^{\dagger} & -iEH^{\dagger} \\ iHE^{\dagger} & HH^{\dagger} \end{pmatrix}$$
(4)

この密度演算子の対角成分にはコヒーレンス行列と呼ばれる偏光度を調べるのによく使われる行列 [3,4] が並んでいる.ここで, $\hat{\rho}$ の時間変化を考える.光の Dirac 方程式 (2) を用いることで光の"Liouville-Neumann 方程式"(5) を導出できる.

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = ic \left[\hat{\rho}, \hat{\mathcal{H}}^{(-)} \right] + ic \left\{ \hat{\rho}, \hat{\mathcal{H}}^{(+)} \right\}$$
 (5)

ここで, $[\cdot,\cdot]$ と $\{\cdot,\cdot\}$ はそれぞれ交換関係と反交換関係で, $\hat{\mathcal{H}}^{(-)}$ と $\hat{\mathcal{H}}^{(+)}$ はそれぞれ $\hat{\mathcal{H}}$ のエルミート部分と反エルミート部分を表している.

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hat{\mathcal{H}} + \hat{\mathcal{H}}^{\dagger}}{2} + i \frac{\hat{\mathcal{H}} - \hat{\mathcal{H}}^{\dagger}}{2i} \equiv \hat{\mathcal{H}}^{(-)} + i \hat{\mathcal{H}}^{(+)}.$$
(6)

この Liouville-Neumann 方程式は Maxwell 方程式を含んでおり, 部分コヒーレントな光も扱える自然な拡張になっている.

また,密度演算子を用いると,例えば光の運動量を表すポインティングベクトルは

$$P = \operatorname{tr}(\hat{P}\hat{\rho}), \quad \hat{P} \equiv \frac{n}{c} \begin{pmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{pmatrix}$$
 (7)

で計算できる. $n = \sqrt{\varepsilon \mu}$ は媒質の屈折率である.

参考文献

- [1] A Bekshaev et al., Phys. Rev. X 5 (2015): 011039.
- [2] S Barnett, New J. Phys. 16 (2014): 093008.
- [3] T Setälä et al., Phys. Rev. E 6 (2002): 016615.
- [4] M Dennis, *J. Opt. A: Pure and Applied Optics* **6** (2004): S26.